

リモート式大気圧プラズマ CVD 法による UV 遮蔽機能を持つ酸化チタン薄膜の生成

執筆者 遠藤 岬^{*1}

要 旨

この研究は、自動車用内外装部品に使用されるポリカーボネート(PC)やポリプロピレン(PP)のUV耐性向上を目的としている。従来の有機系UV吸収剤は、安全性やコスト面で課題があり、代替技術が求められている。そこで、本研究では、化学蒸着(CVD)、具体的には大気圧プラズマCVD(AP-PE-CVD)を用いて酸化チタン(TiO_2)薄膜を成膜した。リモート式AP-PE-CVD技術を使用するこの革新的なアプローチは、複雑な表面や3Dオブジェクトへのコーティングを可能にする。

生成された酸化チタン(TiO_2)は、20%以上のチタンを含み、310 nm波長で14.5%のUV透過率を示し、372 nmよりも短い波長域で効果的なUV遮蔽機能を発揮する。また、この技術は、キャリアガスとしてアルゴンを用いて常温常圧状態で成膜が可能であるため、環境に優しく、大量生産に適している。この研究成果は、今後さまざまなプラスチック部品への応用が期待される。本稿ではこの開発内容について報告する。

1. 大気圧プラズマCVD工法の概要

酸化チタン(TiO_2)薄膜を生成するためのリモート式大気圧プラズマ成膜装置(図-1)に示す。すべての手順は室温および大気圧環境下で行った。キャリアガスとしてアルゴンガス(Ar)を使用し、その流速を20L/minまたは12.5L/minに設定した。アルゴンガスは、アルミニナ誘電体層で被覆された平行平板電極間を通過し、プラズマ励起されながら基板方向に流れる。この際、電極の過熱を防ぐために、水冷方式で電極を冷却できるようにした。

TiO_2 薄膜の成膜には、オルトチタン酸テトライソプロピル($Ti\{OCH(CH_3)_2\}_4$, TTIP)と酸素(O_2)を原料ガスとして組み合わせた。これらのガスの流速は、TTIPが0.2g/min、酸素は0または300mL/minと設定した。原料ガスは、圧送のためにArガス3L/minと混合され、電極下に配置されたパイプ(原料ガス管)を通して供給される。

パルス電源システムは、±11.5kVのピーク電圧、パル

ス繰返し周波数30kHz、パルス持続時間3μsで設定した。基板は電極に対して垂直に配置したプレート上に設置し、基板と原料ガス管の隙間を9mmに保ちながら、プレートを一定速度で移動させることで、試料表面全体に均一な TiO_2 薄膜を成膜することができた。

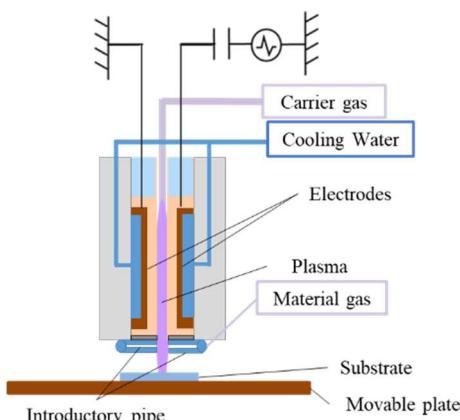


図-1 大気圧プラズマCVD装置

*1 R&D本部 R&D統括部 MBR推進Gr.

2. 実験方法

2-1 試験品の準備

本研究では、製作した薄膜のUV遮蔽効果を評価するため、25mm×25mm、厚さ1mmの石英ガラスを準備した。

2-2 薄膜評価

X線光電子分光法(XPS, JEOL社JPS-9010TR)を用いて、薄膜内のチタン(Ti)濃度を測定した。この測定により、薄膜内の元素組成を定量化し、UV遮蔽能力との相関を確認した。

次に紫外線分光光度計(JASCO Corporation、V-670)を使用して、200~800nmの波長範囲(紫外線~可視光)の透過率測定を行い、特に波長310nmでの透過率に注目した。これは310nmでのUV透過率がポリカーボネート材料のUV劣化に密接に関連しているため、UV劣化に対する薄膜の保護性能を評価するための重要な指標となる。

また、表面形態の観察には走査電子顕微鏡(SEM, FEI.org, Inspect F50)を使用した。

3. 結果と考察

3-1 成膜条件の検証結果

最初に、成膜条件の中でキャリアガスの流量を最適化するため、キャリアガスの流量を変化させながら成膜実験を行い、それぞれの条件で成膜した薄膜をXPSで測定した。特に、 TiO_2 薄膜中のTiとO原子の含有量に着目した。流量20L/minを基準として、2.5L/minずつ変化させながら、安定的にプラズマ放電が行える範囲で成膜を行った。その結果、Ar流量が12.5L/minの時、TiとOの含有量を合わせると76.5%に達した。したがって、キャリアガスArの最適流量は12.5L/minであることが分かった。(図-2)

次に、キャリアガスArの流量を12.5L/minに固定し、酸素流量を0mL/minから400mL/minまで100mL/minずつ増加させ、最適な酸素流量を検証した。その結果、酸素流量400mL/minで、成膜後の試料は白色の外観を示した。外観に異状がない中で、最大のTiとO

含有量を示したのは酸素流量300mL/minの時で、その含有量は77.7%であった。したがって、最適な酸素流量は300mL/minであることが分かった。(図-3)

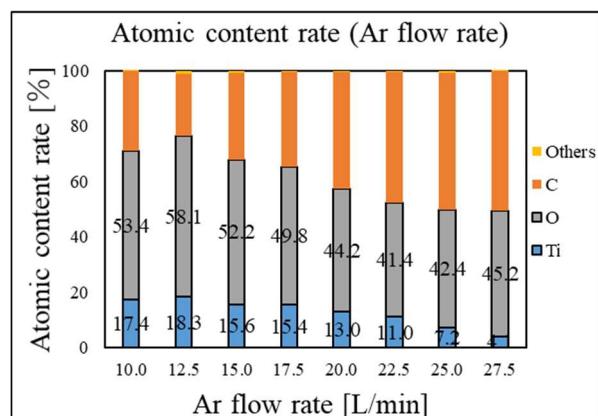


図-2 元素含有量

(酸素流量0mL/minでAr流量を変化させた場合)

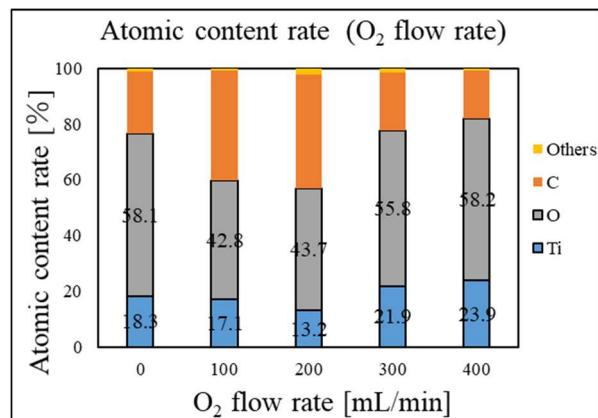


図-3 元素含有量

(Ar流量12.5L/minで酸素流量を変化させた場合)

3-2 UV透過率の測定結果

次に、各成膜条件下での薄膜の評価結果(表-1)、SEM顕微鏡写真(図-4)、および波長と透過率の関係(図-5)を示す。

キャリアガスAr流量が20L/min、酸素流量が0mL/minの試料Aは、粒子の量が少ない表面状態を示した(図-4)。また、透過率測定結果では、波長340nmから紫外線遮断性能を発揮し始め、波長310nmでは約48.0%、波長200nmでは約20%の透過率を示した(図-5)。

対照的に、キャリアガスAr流量を12.5L/minに低減して成膜した試料Bは、大きな粒子が多数存在し

(図-4)、波長 310nm で 41.9% の透過率を示した。この紫外線遮断性能は波長 362nm で始まり、波長 200nm での透過率はわずか 3% であった(図-5)。

さらに、試料 C は酸素流量を 300mL/min 添加した結果、微細なメッシュ構造を示し(図-4)、波長 310nm で 14.5% の透過率を示した。さらに、紫外線遮断性能は波長 372nm で発揮し始め、波長 200nm ではわずか 3% の透過率であった(図-5)。

これらの結果から、紫外線遮断性能の発現は、試料表面上の酸化チタンが微細メッシュ構造を形成することにより、UV が拡散反射されるためであると考えられる。

最終的に、Ar ガスを用いたリモート式 AP-PE-CVD 法で、約 20% のチタンを含む約 320nm 厚の薄膜を成膜した。この薄膜は、可視光(約 360nm より長い波長)を透過し、可視性を確保しながら紫外線を遮断する光学特性を示した。

表-1 TiO₂薄膜の測定パラメータ

	Carrier gas flow rate [L/min]	O ₂ flow rate [mL/min]	Thickness [nm]	Element content [%]		
				Ti	O	Ti+O
A	20.0	0	119	13.0	44.1	57.1
B	12.5	0	242	18.3	58.2	76.5
C	12.5	300	319	21.9	55.8	77.7

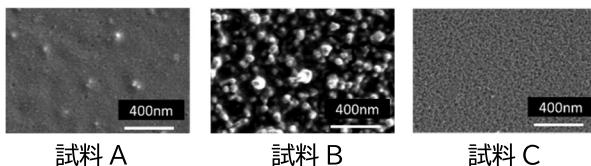


図-4 TiO₂薄膜の SEM 画像

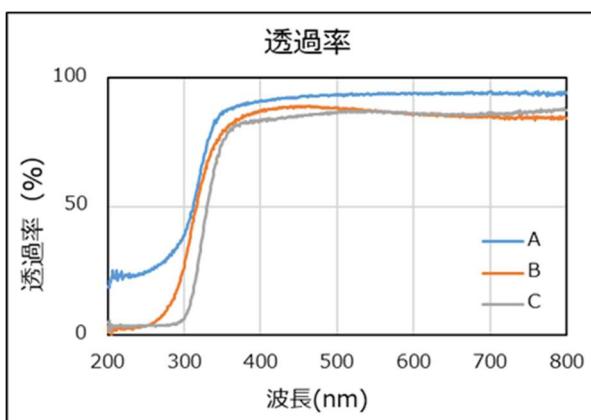


図-5 波長ごとの透過率

3-3 まとめ

TiO₂薄膜は、従来、数百度を超える温度や低圧下で成膜されており、プラスチックなどの低耐熱性基板に成膜することは困難であった。しかし、今回の技術では、室温(25°C)での成膜が可能となり、基板への熱ダメージをほとんど与えることなく、プラスチックなどの低耐熱性基板上にも酸化チタン薄膜を成膜できるようになった。

さらに、従来の方法では、成膜を行うために試料をチャンバー内に配置し、低圧または真空の減圧状態にする必要があった。このため、生産コストの増加や試料のサイズ・形状に制限が生じていた。一方、当社の技術は、減圧状態やチャンバーを使用せず、さまざまな形状の基板にも対応できるため、柔軟な製造が可能となる。また、従来は希少で高価なヘリウム(He)をキャリアガスとして使用していたが、今回の技術では、より安価で入手しやすい Ar を使用することができる。これにより、コスト削減と製造の実現性が大きく向上する。

4. 結論

AP-PE-CVD プロセスを用いて、石英ガラス基板上に TiO₂ 薄膜を成膜することに成功した。今回、TTIP と酸素(O₂)を原料ガスとして使用し、Ar プラズマをキャリアガスとして活用した。成膜された薄膜は、チタン含有量が 20% を超え、非常に微細なメッシュ状の表面構造を持っていた。この薄膜は、372nm で紫外線遮断性能を発揮し始め、310nm では透過率が 14.5%、200nm ではわずか 3% となった。

この技術は、常温・常圧で成膜を行い、キャリアガスにアルゴンを使用するため、大量生産に適している。今後は、この薄膜をさまざまな材料上に成膜することで、紫外線に弱い材料の用途を広げることを目指している。

最後に、本研究は慶應義塾大学との共同研究であり、ご協力いただいた皆様に心より感謝申し上げます。